

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2010年2月18日(18.02.2010)

PCT

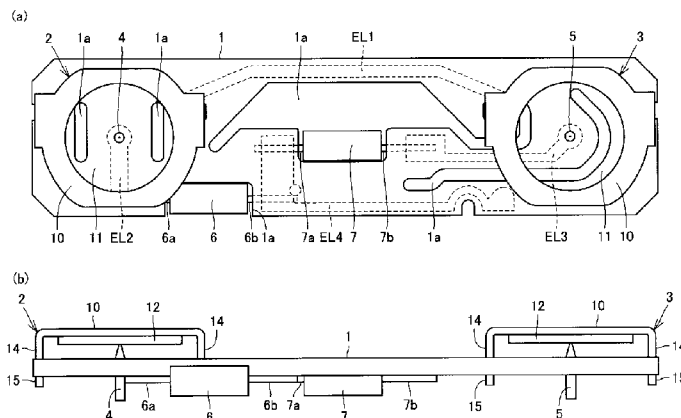
(10) 国際公開番号
WO 2010/018724 A1

- (51) 国際特許分類:
H01T 19/04 (2006.01) H01T 23/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2009/062417
- (22) 国際出願日: 2009年7月8日(08.07.2009)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2008-207177 2008年8月11日(11.08.2008) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): シャープ株式会社(SHARP KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒5458522 大阪府大阪市阿倍野区長池町2番2号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西田 弘 (NISHIDA, Hiromu).
- (74) 代理人: 深見 久郎, 外(FUKAMI, Hisao et al.); 〒5300005 大阪府大阪市北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー22階 深見特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: ION GENERATING DEVICE AND ELECTRIC DEVICE USING THE SAME

(54) 発明の名称: イオン発生装置およびそれを用いた電気機器

[図1]



(57) Abstract: Provided is an ion generating device wherein a dielectric electrode (2) for generating positive ions and a dielectric electrode (3) for generating negative ions are formed as independent components, respectively, and are separately mounted on a substrate (1). Thus, even when the substrate (1) warps due to a temperature change, the leading ends of needle electrodes (4, 5) can be positioned at the center of a through hole (11) of the dielectric electrodes (2, 3), and positive ions and negative ions can be stably generated.

(57) 要約: このイオン発生装置では、正イオン発生用の誘電電極(2)と負イオン発生用の誘導電極(3)との各々を独立部品として形成し、基板(1)上に別々に搭載した。したがって、温度変動に伴って基板(1)が反ることがあっても、針電極(4, 5)の先端部を誘導電極(2, 3)の貫通孔(11)の中心に位置させることができ、正イオンおよび負イオンを安定に発生できる。

WO 2010/018724 A1